

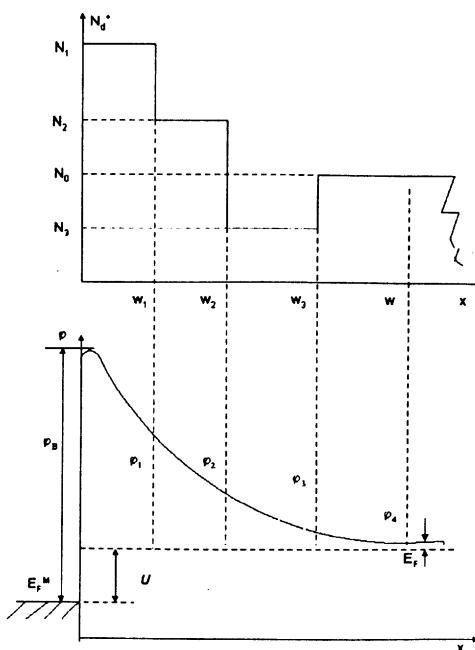
# Nehomogeniškų Šotkio diodų voltamperinių charakteristikų skaitmeninis modeliavimas

Albertas PINCEVIČIUS, Rimantas-Jonas RAKAUSKAS (KA)

el. paštas: pincev@takas.lt, rimantas.rakauskas@tmk.lka.lt

## 1. Uždavinio formulavimas

Augant puslaidininkiniams kristalui, atsitiktinai patekė ar specialiai įterpti kitos rūšies atomai, sukuria puslaidininkio draudžiamoje juostoje donorinius arba akceptorinius priemaišinius lygmenis, kurie keičia jo laidumą. Formuojant ant puslaidininkio metalo kontaktą, t.y., gaminant Šotkio diodą, atliekamą daug technologinių operacijų. Jų metu susidaro sudėtingas pereinamasis sluoksnis su skirtingomis priemaišų koncentracijomis, o dėl puslaidininkio ir metalo elektrono išlaisvinimo darbų skirtumo susiformuoja potencinės barjerai (1 pav.).



I pav. Potencinės barjerai tarp metalo ir puslaidininkio esant skirtingai legiruotoms priemaišomis puslaidininkio sritims.  $N_1, N_2, N_3, N_0$  – donorų koncentracijos,  $E_F^M$  – Fermi lygis metale,  $E_F$  – Fermi lygis puslaidininkijoje,  $\varphi_B$  – barjeras tarp metalo ir puslaidininkio,  $U$  – išorinė įtampa.

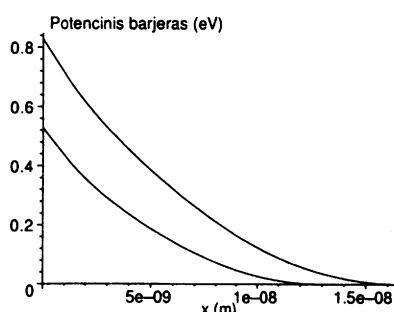
Elektrinio potencailo pasiskirstymas puslaidininkiniame kristale apsprendžia prietaiso voltamperinę charakteristiką (srovės priklausomybę nuo prijungtos įtampos) tiesiogine ir užtveriamaja kryptimi, jo elektrinį talpumą, kuris apriboja prietaiso charakteristikas esant aukštiems dažniams. Jei kiekviename skerspiūvyje puslaidininkio parametrai nesikeičia, potencailo kitimą tūryje aprašo vienmatė Puasono lygtis:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{e}{2\epsilon\epsilon_0} \left( p - n - \sum_{i=1}^n m_i \right), \quad (1)$$

čia  $n, m_i$  – nepusiausvyrinių elektronų koncentracija laidumo zonoje ir priemaišiniuose lygmenyse,  $p$  – skilučių koncentracija valentinėje zonoje,  $\epsilon_0, \epsilon$  – vakumo ir medžiagos dielektrinės konstantos,  $E$  – elektrinio lauko stiprumas. Darbuose [1, 2] parodyta, kad atvejais, kai aktyviųjų donorų koncentracijos pasiskirstymas tūryje atitinka stačiakampius laiptus (1 pav.), kurį praktikoje galima realizuoti molekulinės epitaksijos metodu, potencailo eiga užrašoma taip:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \frac{\epsilon}{2\epsilon\epsilon_0} \left[ (N_1 - N_2)(w_1 - x)^2 + (N_2 - N_3)(w_2 - x)^2 \right. \\ &\quad \left. + (N_3 - N_0)(w_3 - x)^2 + N_0(w - x)^2 \right], \quad \text{kai } 0 \leq x \leq w_1; \\ \varphi_2(x) &= \frac{\epsilon}{2\epsilon\epsilon_0} \left[ (N_2 - N_3)(w_2 - x)^2 + (N_3 - N_0)(w_3 - x)^2 + N_0(w - x)^2 \right], \quad (2) \\ &\quad \text{kai } w_1 \leq x \leq w_2; \\ \varphi_3(x) &= \frac{\epsilon}{2\epsilon\epsilon_0} \left[ (N_3 - N_0)(w_3 - x)^2 + N_0(w - x)^2 \right], \quad \text{kai } w_2 \leq x \leq w_3; \\ \varphi_4(x) &= \frac{\epsilon}{2\epsilon\epsilon_0} N_0(w - x)^2, \quad \text{kai } w_3 \leq x. \end{aligned}$$

Tada, pereinant nuo vieno intervalo prie kito, yra sulyginamos potencialų ir jų išvestinių reikšmės. Formulės kokybiškai nekinta, jei intervalų skaičius didėja ar mažėja, gaunama analinė potencailo eigos išraiška. Elektrinio potencailo pasiskirstymo tūryje pavyzdys parodytas 2 pav.



2 pav. Elektrinio potencailo pasiskirstymas tūryje  $\varphi_B = 0,94 \text{ eV}$ ,  $T = 300 \text{ K}$ , viršutinė kreivė –  $U = 0,1 \text{ V}$ , apatinė –  $U = 0,4 \text{ V}$ .

Skaičiavimuose naudotos tokios parenkamų parametru reikšmės:

$$\begin{aligned} N_1 &= 3 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}, & N_2 &= 6 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}, \\ N_3 &= 5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}, & N_0 &= 3 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}, \\ w_1 &= 5 \cdot 10^{-9} \text{ m}, & w_2 &= 2 \cdot 10^{-8} \text{ m}, & w_3 &= 8 \cdot 10^{-8} \text{ m}. \end{aligned}$$

Sprendinys (2) buvo atspėtas, surastos laipsninės eilutės gerai aproksimuojančios sprendinį plačiame intervale. Priešingu atveju būtų integruojama intervalais truki funkcija ir gaunamas sudėtingesnis rezultatas. Srovė, tekanti per prietaisą, užrašoma formule:

$$I = \frac{en_0 v_t S}{4kT} \int_0^{\infty} D(E_x) f(E_x) dE_x, \quad (3)$$

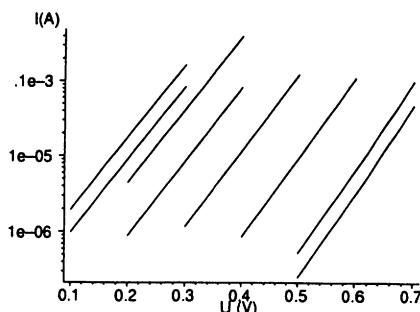
čia  $v_t$  – elektronų šiluminis greitis,  $S$  – prietaiso skerspiūvio plotas,  $k$  – Boltmano konstanta,  $T$  – temperatūra pagal Kelvino skalę,  $f(E_x)$  – Fermio pasiskirstymo funkcija,  $D(E_x)$  – elektrono tuneliavimo per potencialinį barjerą tikimybė, kuri  $VKB$  artinio atveju užrašoma formule:

$$D(E_x) = \exp \left\{ -2 \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{2m^*}{h^2} |E_x - \varphi(x)|} dx \right\}, \quad (4)$$

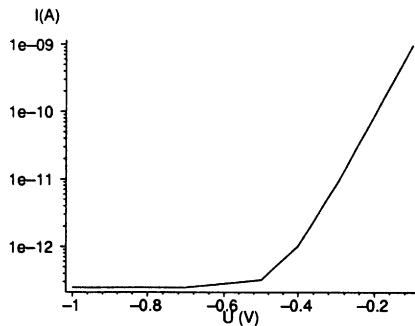
$h$  – Planko konstanta,  $m^*$  – elektrono efektinė masė, t.y., jo masė tinkanti aprašant judėjimą puslaidininkio laidumo zonoje,  $E_x$  – elektrono energija taške  $x$ .

Dydžiai formulėse (3) ir (4) vieni labai dideli, kiti labai maži (skiriasi iki 30 eilių), todėl integralų (4) ir (3) paskaičiavimas yra pakankamai specifinis. Paprastai rezultatai su eksperimentu derinami plačiame temperatūrų intervale. Voltamperinių charakteristikų paskaičiavimo pavyzdys pateiktas 3 pav.

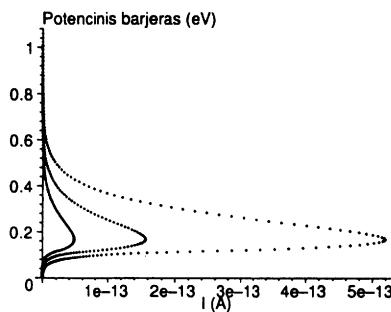
Galima surasti prietaiso voltamperinę charakteristiką (VACh) užtveriamaja kryptimi (4 pav.). Tirti elektronų tuneliavimą per potencinių barjerą. Tunelinės srovės dedamosios parodytos 5 pav. Toks tyrimas labai reikalingas projektuojant aukštadažnius prietaisus.



3 pav. Šotkio diodo voltamperinės charakteristikos  $I = I(U)$  plačiame temperatūrų intervale (iš kairės): 1 – 350 K, 2 – 325 K, 3 – 300 K, 4 – 250 K, 5 – 200 K, 6 – 150 K, 7 – 100 K, 8 – 77 K.



4 pav. Šotkio diodo voltamperinė charakteristika atbuline kryptimi. Barjero aukštis  $\varphi_B = 0,94 \text{ eV}$ ,  $T = 300 \text{ K}$ .



5 pav. Tunelinės srovės dedamosios (voltamperinė charakteristika atbuline kryptimi kaip ir 4 pav.). Kreivės (iš kairės) atitinkamai:  $U = -0,05 \text{ V}$ ,  $U = -0,1 \text{ V}$ ,  $U = -0,15 \text{ V}$ .  $T = 300 \text{ K}$ ,  $\varphi_B = 0,94 \text{ eV}$ .

## 2. Rezultatų aptarimas

Darbe pateikiama metodika, leidžianti, pasinaudojant skaitmeninio modeliavimo rezultatais, ivertinti Šotkio diodo ir jo sąlyčio srityje parametrus: aktyvių priemaišų pasiskirstymą sąlyčio srityje, šiu priemaišų pasiskirstymą sąlyčio plokštumoje, patikslinti diodo barjero aukštį, tirti tuneliavimo per barjerą mechanizmus ir t.t. Šie uždaviniai aktualūs projektuojant ir tobulinant puslaidininkinius prietaisus ir padeda sumažinti brangiai kainuojančių eksperimentų skaičių [1, 2, 3, 4]. Galima spręsti kitą uždavinį – projektuoti prietaisus su norimomis charakteristikomis. Molekulinės epitaksijos metodu galima keisti priemaišinių atomų koncentraciją labai siauruose sluoksniuose ir gauti norimus prietaisų parametrus.

## Literatūra

- [1] A. Pincevičius, L. Papirytė, T. Pėstininkas, J. Matukas, Priemaišų pasiskirstymo kontaktu srityje įtaka galio arsenido Šotkio diodų voltamperinėms charakteristikoms, *Lietuvos Fizikos Rinkinys*, T. XXVIII, 6, 737–743 (1988) (rusų k.).

- [2] J. Matukas, V. Palenskis, A. Pincevičius, S. Smetona, The influence of low energy radiation in gallium arsenide surface on the current-voltage, capacitance-voltage and noise characteristics of Schottky-barrier diodes. *10-th International Conference "Noise in Physical Systems"*, abstract, Budapest, 135–137 (1989).
- [3] J. Osvald, Numerical study of electrical transport in inhomogeneous Schottky diodes, *Journal of Applied Physics*, **85**(3), 1935–1942 (1999).
- [4] T.W. Crowe, J.L. Hesler, R.M. Weikle, S.H. Jones, GaAs devices and circuits for terahertz applications, *Infrared Physics & Technology*, **40**, 175–189 (1999).

## **Numerical simulation of the current-voltage characteristics of the inhomogeneous Schottky diodes**

A. Pincevičius, R.-J. Rakauskas

In this paper we offer methods for estimation parameters of diodes of the Schottky by comparing outcomes of calculations and experiment. Definite some parameters of contact area: allocation of an active impurity in this area, to define more precisely a potential barrier in the area, to study tunnel mechanisms of electrons through this potential barrier. Such tasks are important from the practical point of view at improvement of performances of devices. One more problem the procedure helps to decide-to design devices with the established volt-ampere characteristic. In this case we can offer the corresponding allocation of an impurity in contact area, to select a technology for engineering of contact of the Schottky.